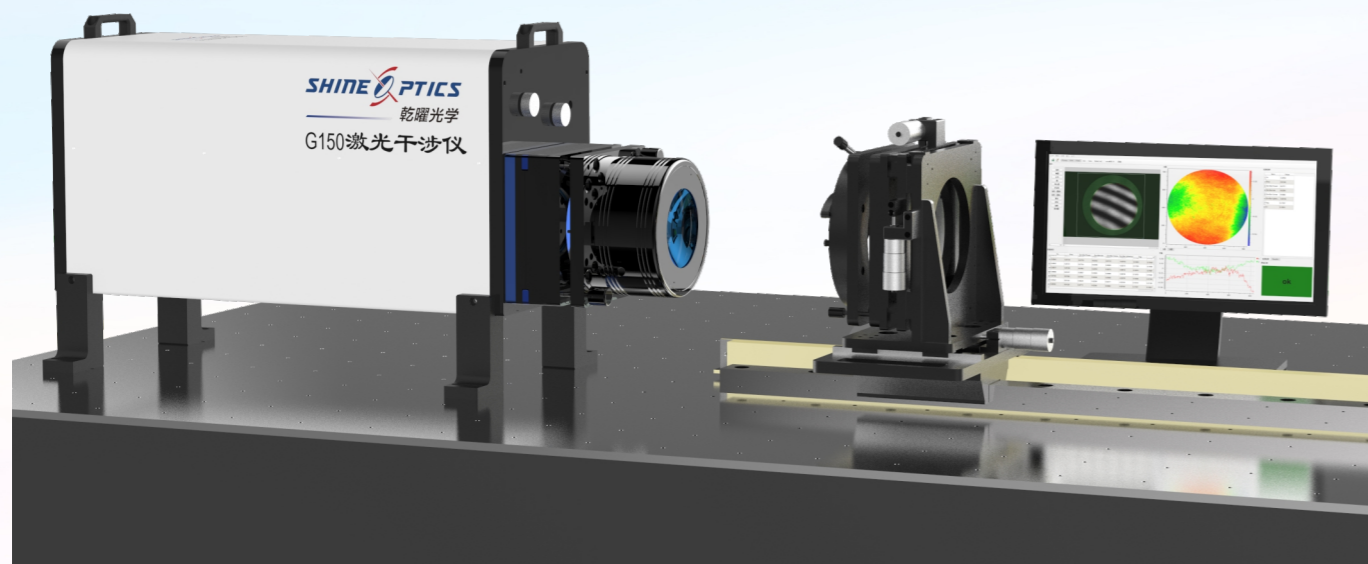


“G系列”中口径卧式激光干涉仪

精密、高性价比、具有抗振功能激光干涉仪

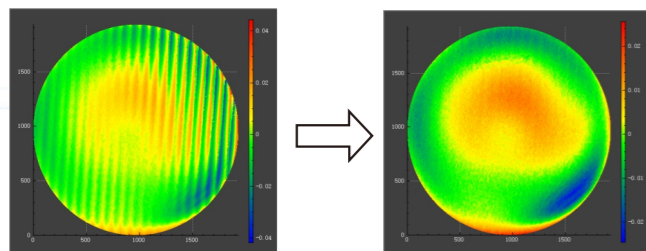
G100、G150和G200激光干涉仪的有效口径分别为101.6mm（4英寸）、152.4mm（6英寸）和200mm。菲索型的共光路设计结合Sirius抗振移相干涉条纹分析软件实现高精度的面形和波前测量。可扩展成立式平面和倒立式球面等多种结构形式的干涉仪。

G系列激光干涉仪定位高性价比的精密激光干涉仪，可以进行平面面形、平行度、波前和材料均匀性，球面面形、曲率半径以及光学系统波像差等几乎所有的干涉测量，可测量材料包含玻璃、塑胶、陶瓷、硅片和抛光的金属。



关键性能

乾曜Sirius抗振移相测量技术，在振动和环境中稳定测量。



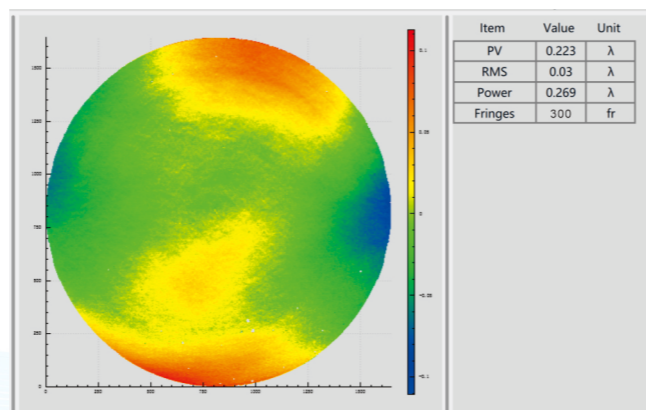
振动波纹

Sirius 抗振移相模式解析

核心器件均为国际一线品牌，性能优越，质量稳定。大批量移相器已完成数千万次移相。

提供进行干涉测量的所有附件，尤其标准镜种类集合了美国和日本厂家的型号，满足各种场景的需求。

高清分辨率：高清光学系统设计，优秀的衍射光学设计，横向分辨率达到全口径分辨条纹数 > 300对，优秀的中频测量能力。



可接入短相干激光器测量平行平板，消除自身干涉的影响，氦氖与短相干快速切换。

仪器规格参数表

产品型号	G100	G150
测量方式	菲索干涉原理	
有效通光口径	101.6mm (4英寸)	152.4mm (6英寸)
光源	氦氖激光 (632.8nm)，可选短相干激光器	
相机	靶面1/1.2"，有效成像分辨率1.2Kx1.2K	
横向分辨率	全口径分辨条纹数 > 300对 (机械移相模式)	
软件算法	Sirius抗振移相和瞬态载波	
RMS简单重复性 (2σ)	<λ/10000	
RMS波前重复性 (mean+2σ)	<0.6nm	
长期稳定性 (2σ)	<2.2nm	
连续变焦倍数	1-6倍	
移相方式	压电陶瓷机械移相	
对准方式	十字线两点对准，对准角度±3°	
光瞳调焦范围	±2.5m	±5.5m
光学中心高	220mm	
透射标准镜材料	尼康熔石英 均匀性优于2ppm，应力优于2nm/cm	
反射标准镜材料	进口微晶	
平面标准镜精度	PV: 优于λ/20	
球面标准镜精度	PV: 优于λ/10和λ/20	
电源	100-240VAC, 50/60Hz	
尺寸 (长宽高)	704X330X460mm	844X386X488mm
重量	40KG	50KG
工作环境温度	15°C - 30°C	
温度变化率	<1.0°C/30min	
湿度	不大于70%	
隔振	机械移相测量模式推荐使用波动隔振系统	
质量标准	GJB/J 6221-2008	